

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в измерительных приборах, в которых используются наносенсоры на основе наноструктурных полупроводниковых оксидов. Устройство для измерения параметров сенсоров на основе микро- и наноструктурных полупроводниковых оксидов включает источник опорного напряжения (U_{ref}), напряжение которого подается на вход одного из аналого-цифровых преобразователей (ADC) микроконтроллера (MCU) через операционный усилитель, и который соединен последовательно с исследуемой наноструктурой (R_x) и дополнительным резистором (R_0), а падение напряжения на резисторе (R_0) подается на вход второго аналого-цифрового преобразователя (АЦП) микроконтроллера (MCU) через второй операционный усилитель. Выход микроконтроллера (MCU) подключен к экрану для отображения полученного результата.

П. формулы: 1

Фиг.: 2

